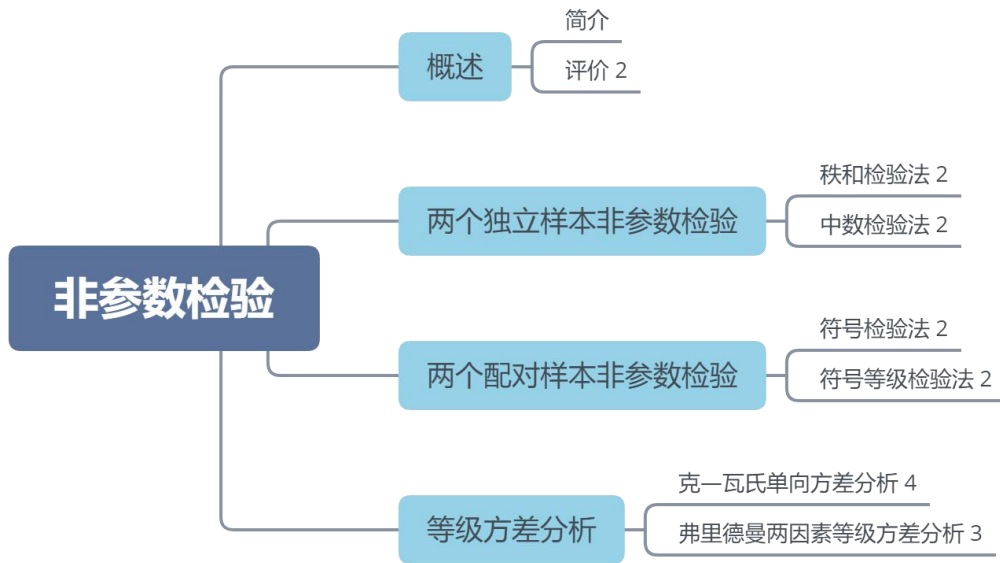


第十一章 非参数检验



一、概述

(一) 简介

在实践中,对研究的总体可能知之不多,有时对参数检验中的诸多要求和假定难以满足,这时就应该使用非参数检验。如:斯皮尔曼等级相关、 χ^2 检验。

(二) 评价

1. 优点

- (1) 不需要严格的前提假设;
- (2) 特别适合顺序变量;
- (3) 特别适合小样本,计算很快。

2. 缺点

- (1) 未能利用数据的全部信息;
- (2) 不能处理交互作用。

二、两个独立样本的非参数检验

(一) 秩和检验法

又称“维尔克松两样本检验法”“曼-特尼维尔克松秩和检验”“曼-特尼 U 检验”。

对应参数检验中“独立样本的 t 检验”,且当两独立样本均为顺序变量时也可以使用。

其中,秩代表数据经过从小到大排序后的等级,秩和表示等级之和。

1. 小样本 ($n_1 \leq 10, n_2 \leq 10$)

- (1) 将两样本数据混合,从小到大排序,求秩次;
- (2) 对容量较小的样本求秩和,记为 T;
- (3) 查表,若 $T \leq T_1$ 或 $T \geq T_2$,则两样本差异显著;若 $T_1 < T < T_2$,则差异不显著。

2. 大样本 ($n_1 > 10, n_2 > 10$)

T 值分布服从近似正态分布,使用近似 Z 检验:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} \quad \mu_T = \frac{n_1 (n_1 + n_2 + 1)}{2} \quad Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T}$$

(二) 中数检验法

对应着参数检验中的“两独立样本平均数之差的 t 检验”，用中数作为集中趋势的量度，与秩和法的适用条件基本相同。

(1) 将两个样本数据混合，从小到大排列，求混合排列的中数。

(2) 分别找出每一样本中大于混合中数及小于混合中数的数据个数，列成四格表对四格表进行卡方检验。

$$\chi^2 = N \left(\sum \frac{f_{oi}^2}{f_{xi} f_{yi}} - 1 \right) \quad \chi^2 = \frac{N(AD - BC)^2}{(A+B)(A+C)(B+D)(C+D)}$$

三、两个配对样本的非参数检验

(一) 符号检验法

用于检验两个配对样本分布的差异。

对应参数检验中“配对样本差异显著性 t 检验”，也是以中数作为集中趋势的量度。

1. 小样本（对子数 $N \leq 25$ ）

(1) 对于每对数据之差，不计大小，只记符号。正号的个数记为 n_+ ，负号的个数记为 n_- ，0 不记在内。 $N = n_+ + n_-$ ， $r = \min(n_+, n_-)$ 。

(2) 查符号检验表，若 r 大于表中临界值，则差异不显著，即接受虚无假设（与一般参数检验相反，要特别注意）。可以看出与 n_+ 与 n_- 差得越多，越显著。

2. 大样本（对子数 $N > 25$ ）

n_+ 和 n_- 符合二项分布， $N > 25$ 时服从正态分布，故可用 Z 检验。

$$\mu = np = \frac{N}{2}, \quad \sigma = \sqrt{Npq} = \frac{\sqrt{N}}{2} \quad Z = \frac{r - \mu}{\sigma}$$

为更接近正态分布，常用校正公式：
$$Z = \frac{(r + 0.5) - \mu}{\sigma}$$

检

(二) 符号等级
验法

又称“符号秩和检验”“维尔克松检验法”“维尔克松 T 检验”，精确度比符号检验法高，在考虑差值的符号的同时还考虑差值大小。

对应参数检验中“配对样本差异显著性 t 检验”。

1. 小样本（对子数 $N \leq 25$ ）

(1) 一对数据之差按绝对值从小到大排列（0 不参加）；

(2) 在等级前添正负号；

(3) 求出带正号的等级和 (T_+) 与带负号的等级和 (T_-)，取两者之中较小的记作 T， $T = \min(T_+, T_-)$ ；

(4) 查表检验，若大于表中临界值，则差异不显著（与一般参数检验相反，要特别注意）。

2. 大样本（对子数 $N > 25$ ）

$N > 25$ 时，T 分布接近正态，使用 Z 检验：

$$\mu_T = \frac{N(N+1)}{4}, \quad \sigma_T = \sqrt{\frac{N(N+1)(2N+1)}{24}} \quad Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T}$$

四、等级方差分析

当方差分析三大前提不满足时使用。

（一）克-瓦氏单向方差分析

又称“克-瓦氏 H 检验”，对应“完全随机设计”的方差分析。

1. 将所有数据混合，排序；
2. 求出各个处理内的秩和，记为 R_i ；
3. 计算 H 值：

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_1^K \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

n = 某处理组中样本容量，
 K = 处理数
 R_i 为每种处理中的等级和

4. 查 H 表，大于临界值说明差异显著。

（二）弗里德曼两因素等级方差分析

对应“随机区组设计”的方差分析。

- (1) 将每一区组的 K 个数据（ K 为实验处理数）从小到大排出等级；
- (2) 求出每种实验处理 n 个数据等级和，以 R_i 表示；
- (3) 代人公式

$$\chi_r^2 = \frac{12}{nK(K+1)} \sum R_i^2 - 3n(K+1)$$

n = 区组个数， K = 处理数
 R_i 为每种处理中的等级和

	独立样本均值		相关样本均值	
	参数检验	非参数检验	参数检验	非参数检验
2个组	两独立样本t检验	秩和检验法	两个配对样本分布的差异	符号检验法
	两独立样本之差的t检验	中数检验法	配对样本差异显著性t检验	符号等级检验法
3个及3个以上组	方差分析的完全随机设计	克-瓦氏单向方差分析	随机区组设计	弗里德曼两因素等级方差分析